

# Nano Aperture Microprobe Array produced by FIB process for Integrated Optical Recording Head

임동수<sup>†</sup>. 오종근\*. 김영주\*

**Key Words :** Optical data storage, microprobe array, near-field optics, FIB process, nano-aperture

## ABSTRACT

새로운 고 용량 광 저장 시스템 개발을 위하여 초 미세 개구를 가지는 마이크로 프로브 어레이 시스템 완성을 목표로 연구를 진행하였다. 효율적인 초 미세 개구 생성을 위해 기존의 제작된 마이크로 프로브 위에 FIB 공정을 이용하여 40nm 크기를 가지는 어퍼쳐를 만들었다. 나노 어퍼쳐를 가지는 마이크로 프로브 어레이는 곧 마이크로 렌즈와 VCSEL 과 일체화된 광 기록 헤드 시스템으로 준비될 예정이다. 멈스 공정을 이용한 이 시스템은 향후 높은 저장 용량과 빠른 전송 속도를 달성할 수 있는 차세대 광정보저장기기에 적용 가능한 새로운 광 핵심 시스템을 발전시킬 수 있을 것으로 생각된다.

## 1. 서 론

정보 기술과 디지털 컴퓨터의 발전을 대표하는 홈 네트워크는 IT 산업에서 새로운 분야로써 각광 받고 있다. 정보 컨텐츠의 발전은 높은 용량의 저장 장치를 요구하고 있으며 굉장히 빠른 속도로 그 수요가 증가하고 있다. 정보 저장 시스템 중 하나인 광 정보저장장치는 오디오, 비디오, 컴퓨터, 게임, 자동차 오디오 등에 적용되어 기록하고 재생하는 분야로 그 응용성을 확대하고 있으며 고 용량에 대한 소비자의 욕구를 충족시키기 위해 새로운 정보저장 방식에 대한 연구들이 활발히 진행되고 있다.

고 용량 광 정보저장기기를 실현 시키기 위한 여러 연구가지 접근 방식 중 하나인 근접장을 이용한 기존의 마이크로 프로브<sup>1,2)</sup>는 낮은 광효율

과 높은 데이터 전송 속도 때문에 고 용량 정보 저장기기를 실현시키기 위한 제약을 가지고 있다. 그러므로 이러한 한계를 극복하기 위한 방안으로 마이크로 프로브 어레이를 마이크로 렌즈와 VCSEL 을 이용하여 하나의 통합 시스템으로 구현하고자 한다. Fig. 1에서 볼수 있듯이 이 시스템은 멀티 기록 헤드와 초 미세 개구를 가지는 VCSEL 마이크로 프로브를 기반으로 하며 이로 인한 고용량 저장과 빠른 데이터 전송속도를 실현 시킬 수 있을 것으로 판단된다. 이 VCSEL 마이크로 프로브 어레이 시스템을 구현시키기 위한 첫 단계로 우리는 나노 어퍼쳐를 가지는 마이크로 프로브를 준비하였다.

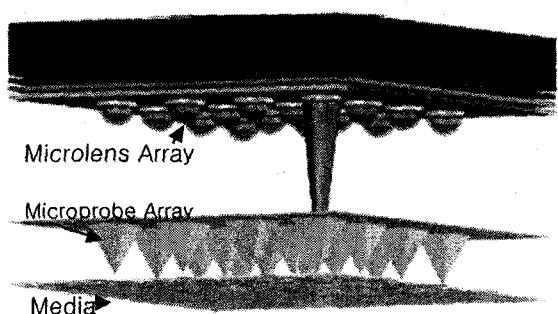


Fig. 1. Concept of Integrated VCSEL Microprobe Array

<sup>†</sup> Center for Information Storage Device (CISD),  
Yonsei University, Seoul 120-749, Korea  
E-mail : baragist@empal.com  
TEL : (02)843-3073 FAX : (02)365-8460

\* Center for Information Storage Device (CISD),  
Yonsei University, Seoul 120-749, Korea

## 2. 실험결과

Fig. 2에서 볼 수 있듯이 마이크로 프로브 어레이는 비등방성 식각과 스퍼터링을 사용하여 Au 코팅된  $15\text{ }\mu\text{m} \times 15\text{ }\mu\text{m}$  크기로 제작하였고 제작된 마이크로 프로브에 초 미세 개구를 만들기 위하여 우리는 FIB 공정<sup>3)</sup>을 사용하였다. FIB는 고전압에 의해 가속된 이온을 나노 단위로 집속시킨 이온빔으로 미세 가공에 유용하다. 이번 실험에서는 이온빔의 직경을 4nm로 하여 수 초 동안 진행하였다.

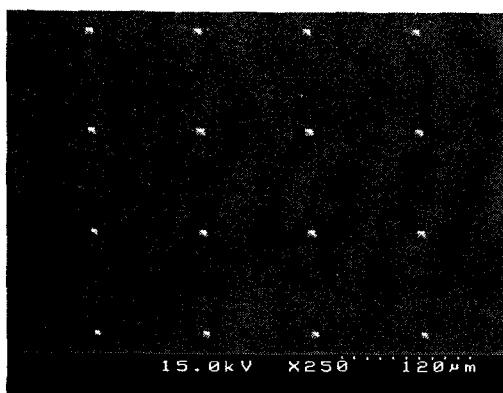


Fig. 2 SEM photo Microprobe array

Fig.3 (a), (b)는 FIB 공정 후에 얻은 미세 개구를 보여준다. 직경 크기 40nm인 개구를 얻었으며 이러한 미세 크기는 회절한계를 극복하기 위한 근접장광기록 장치의 고출력, 고효율을 달성하기 위한 가능성을 보여주었다.

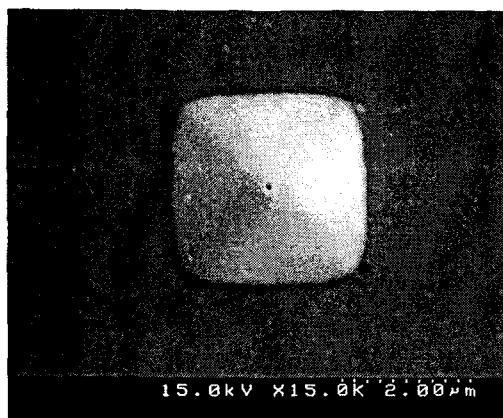


Fig. 3 (a) Microprobe aperture-tip formed by FIB process



Fig. 3(b) Nano-aperture microprobe formed by FIB process

## 3. 결 론

근접장광기록용 마이크로 프로브는 근접장광의 특성에 대응할 수 있도록 미세 크기의 개구를 가져야 한다. 이에 본 논문에서는 40nm 크기의 미세 개구를 갖는 마이크로 프로브 어레이를 제작, 근접장광기록 방식의 가능성을 열었다. 이와 같이 제작된 프로브의 광효율을 극대화 하기 위하여 향후 마이크로 렌즈와 VCSEL과 결합시켜 일체형 광기록 헤드 시스템을 개발하고자 한다. 이러한 시스템은 높은 광효율을 통하여 고밀도 광기록 장치용 헤드 방식에 있어 새로운 방향을 제시할 것으로 보인다.

## 참고문헌

- (1) Y.-J Kim, K. Suzuki and K. Goto  
Jpn. J. Appl. Phys., 40 (2001) 1783-1789.
- (2) K. Goto, Y.-J Kim, T. Kirigaya and Y. Masuda  
Jpn. J. Appl. Phys., 43(2004) 5813.
- (3) Michael J. Vasile, Raja Nassar, and Jushan Xie  
Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures -- July 1998 -- Volume 16, Issue 4, pp. 2499-2505